

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第1部門第2区分

【発行日】平成20年10月23日(2008.10.23)

【公開番号】特開2000-60823(P2000-60823A)

【公開日】平成12年2月29日(2000.2.29)

【出願番号】特願平11-225896

【国際特許分類】

A 61 B 5/055 (2006.01)
G 01 R 33/385 (2006.01)

【F I】

A 61 B 5/05 320
A 61 B 5/05 340
G 01 N 24/06 510Y

【手続補正書】

【提出日】平成20年9月5日(2008.9.5)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】MRIシステム用磁石アセンブリにおいて、外壁及びボア軸線を有する容器シリンダと、前記容器シリンダ外壁の端部に固着され、そこから半径方向内向きに延在する1対の環状端板と、前記端板に固着され、前記容器シリンダ外壁より半径方向内側でボア軸線のまわりに中心合わせされた円筒形内壁であって、非磁性で非導電性の材料から形成されて、前記容器シリンダ外壁及び端板とともに真空容器を形成する円筒形内壁と、前記磁石アセンブリのボア内に装着され、且つ前記内壁より半径方向内方で前記内壁に隣接して配置された円筒形勾配コイル・アセンブリとを備え、

前記内壁は、第1非導電性層(80)により形成され、蒸気バリアが前記第1非導電性層(80)に形成されており、前記蒸気バリアが前記第1非導電性層(80)のまわりに巻回した複数のリボンを備え、各リボンは非導電性材料がその上に形成された金属ホイル層を備えており、連続するリボン同士が重なり合い、前記非導電性材料の層が重なり合う金属ホイル層の間に相互的な電気的な絶縁を提供することを特徴とするMRIシステム用磁石アセンブリ。

【請求項2】前記第1非導電性層(80)がエポキシ・ガラス複合材料から形成されている請求項1に記載の磁石アセンブリ。

【請求項3】前記第1非導電性層(80)がエポキシ・ガラス複合材料の層を巻回して形成されている請求項2に記載の磁石アセンブリ。

【請求項4】前記非導電性材料がエポキシ・ガラス複合材料からなる請求項1に記載の磁石アセンブリ。

【請求項5】更に、前記蒸気バリアのまわりに形成された第2非導電性層を備えている請求項1に記載の磁石アセンブリ。

【請求項6】前記第1及び第2非導電性層がエポキシ・ガラス複合材料を巻回して形成されている請求項5に記載の磁石アセンブリ。

【請求項7】前記内壁の各端部に形成されたフランジを更に含み、該フランジは、真空シールを達成するように対応する前記端板に締め付けられる形状を有している請求項1に記載の磁石アセンブリ。

【請求項8】1対のOリングを更に含み、前記フランジの各々がこれらのOリングの対

応する一つを収容して該端板に対してシールする形状を有している請求項7に記載の磁石アセンブリ。